

機器名 Mo 線源粉末 X 線回折装置 (RINT2200)

1. 概要

本装置は Mo $K\alpha$ 線 (波長 0.071073 nm) を用いた粉末 X 線回折装置です。受光側にグラファイトモノクロメーターを備えており、低バックグラウンドの回折データの取得が可能です。主にガラス、非晶質材料、ナノ粒子など、結晶性の低い材料を対象とします。Cu 線源装置と比較して、Mo 線源は波長が短く、より広い散乱ベクトル領域を測定できるため、結晶相の同定だけでなく、非晶質の原子レベルでの短距離秩序や中距離構造の評価に適しており、原子対相関関数 (PDF) 解析のための基礎データ取得などに利用可能です。

2. 特性

機種名：試料水平型 X 線回折装置 (リガク・RINT2200)

X 線源：Mo (封入管)

光学系：入射スリット、出射スリット、受光側グラファイトモノクロメーター、受光スリット



3. 設置場所

トレーサ棟 機器分析室 2 (管理区域内)

4. 提出書類

装置担当者と要相談

5. 装置担当者、連絡先

有馬 寛 (内線：2678)